

RASTERELEKTRONENMIKROSKOP

LEO 1455 VP (ZEISS)



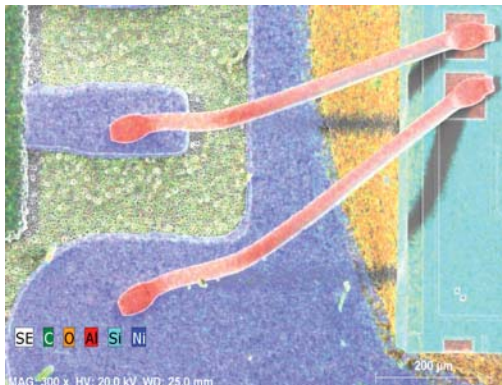
TECHNISCHE DATEN

Quelle:	Standardwolframelektrode
Stage:	5 Achsen, motorisiert (x,y,z, Drehung, Kippung)
Probe:	maximal 500 g maximal 140 mm x 140 mm
Detektoren:	Sekundärelektronen-Detektor (SE) Rückstreuendetelektor mit Composition/Topography Mode (QBSD) SE-Detektor für VP-Mode (VPSE) Detektor X-Flash 3001(EDX)
Hersteller:	Zeiss



AUSSTATTUNG

- Hochvakuum-Mode (HV-Mode) für leitende Proben mit Vergrößerungen probenabhängig bis zu 100.000x
- Variable Pressure Mode (VP-Mode, 30 ... 60 Pa) für nichtleitende Proben mit Vergrößerungen probenabhängig bis zu 5000x
- Beschichtungsanlage zum Beschichten nicht leitfähiger Proben mit Au oder C
- Bildauswerte-Software analySIS



ENERGIEDISPERSIVE RÖNTGENFLUORESZENZANALYSE

- Qualitative Elementanalyse ab Bor
- Quantitative standardfreie Elementanalyse über P/U-ZAF-Korrektur
- Objekt-, Line-, Mapping-Modus

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Charakterisierung von Oberflächenstrukturen
- Qualitätskontrolle und -sicherung
- Schadensanalytik